

# 中华人民共和国国家计量技术规范

JJF 1092-2002

## 光切显微镜校准规范

Calibration Specification for Light-Section Microscopes

2002-11-04 发布

2003-05-04 实施

### 光切显微镜校准规范

Calibration Specification for Light-Section Microscopes

JJF 1092—2002 代替 JJG 76—1980

本校准规范经国家质量监督检验检疫总局于 2002 年 11 月 4 日批准, 并自 2003 年 5 月 4 日起施行。

归口单位:全国几何量工程参量计量技术委员会

主要起草单位:广西计量测试研究所

陕西省计量测试研究所

上海光学仪器研究所

### 本规范主要起草人:

全贻智 (广西计量测试研究所)

张 磊 (陕西省计量测试研究所)

张兴德 (上海光学仪器研究所)

## 目 录

1	范		(1)
2	引	用文献	(1)
3	概.	述	(1)
4	计	量特性	(1)
4. 1		测微目镜视场及示值误差	(1)
4. 2		狭缝像两边缘的直线度和平行度	(2)
4.3		工作台纵横向导轨移动平面对工作台表面的平行度	(2)
4.4		狭缝像在垂直方向的弯曲度	(2)
4.5		托架受 20N 侧向力时引起物方像的位移 ······	(2)
4.6		仪器示值误差	(2)
5		准条件	(3)
5. 1		环境条件	(3)
5. 2	-	测量标准器及其他设备	(3)
6		准项目和校准方法	(3)
6. 1		测微目镜视场及示值误差	(3)
6. 2		狭缝像两边缘的直线度和平行度	(4)
<b>6.</b> 3		工作台纵横向导轨移动平面对工作台表面的平行度	(4)
6.4		狭缝像在垂直方向上的弯曲度	(4)
6.5		托架受 20N 侧向力时引起物方像的位移 ······	(4)
6.6	,	仪器示值误差	(4)
7	校	准结果的表达	(6)
8	复	校时间间隔	(6)
附表	<b>录</b> A	A 仪器示值误差校准结果的测量不确定度评定	(7)
附表	录 E	3 校准证书内容	(9)

### 光切显微镜校准规范

#### 1 范围

本规范适用于光切显微镜的校准。

#### 2 引用文献

本规范引用下列文献:

JJF 1001-1998 通用计量术语及定义

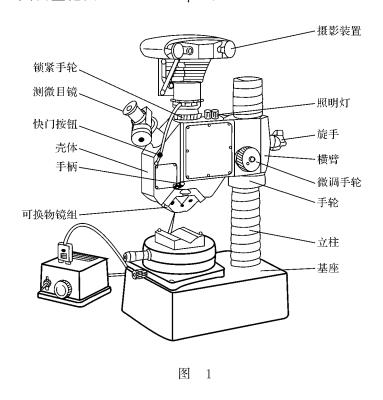
JJF 1059—1999 测量不确定度评定与表示

GB/T 1031-1995 表面粗糙度参数及其数值

使用本规范时, 应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

#### 3 概述

光切显微镜外形结构如图 1 所示,它以光切法测量原理(图 2)测量表面粗糙度的轮廓峰高和谷深,其测量范围(1.0 $\sim$ 80) $\mu$ m。



#### 4 计量特性

#### 4.1 测微目镜视场及示值误差

测微目镜鼓轮指示零位时,测微目镜分划板的毫米刻线应套在双刻线指标内。 在仪器视场中,狭缝像与被测物的像应能同时调节清晰,并处于视场中央,其清晰